【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年6月23日(2011.6.23)

【公開番号】特開2010-263210(P2010-263210A)
【公開日】平成22年11月18日(2010.11.18)
【年通号数】公開・登録公報2010-046
【出願番号】特願2010-103590(P2010-103590)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/027　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/30　　５３１Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月9日(2011.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
前記エミッタ材料供給ユニット（４）は、前記貯溜容器（４１）または前記再利用容器（８３）に選択的に接続される低圧ガスシステム（７２）に接続され、前記エミッタ材料（２）を前記貯溜容器（４１）から前記圧力容器（４４、４４’）の一方に輸送するか、あるいは前記貯溜容器（４１）に再利用のエミッタ材料（２）を充填することを特徴とする請求項２に記載の装置。